

FIB-SEM

品牌: TESCAN
型号: SOLARIS

TESCAN SOLARIS 为纳米加工和纳米技术研发提供完整的微米量级 FIB-SEM 解决方案。TESCAN SOLARIS 完美的结合了高精度聚焦离子束 (FIB) 和采用 TriLens™ 型浸没式设计的超高分辨扫描电镜 (SEM)，实现了离子束刻蚀和扫描电镜超高分辨率成像的最佳组合。

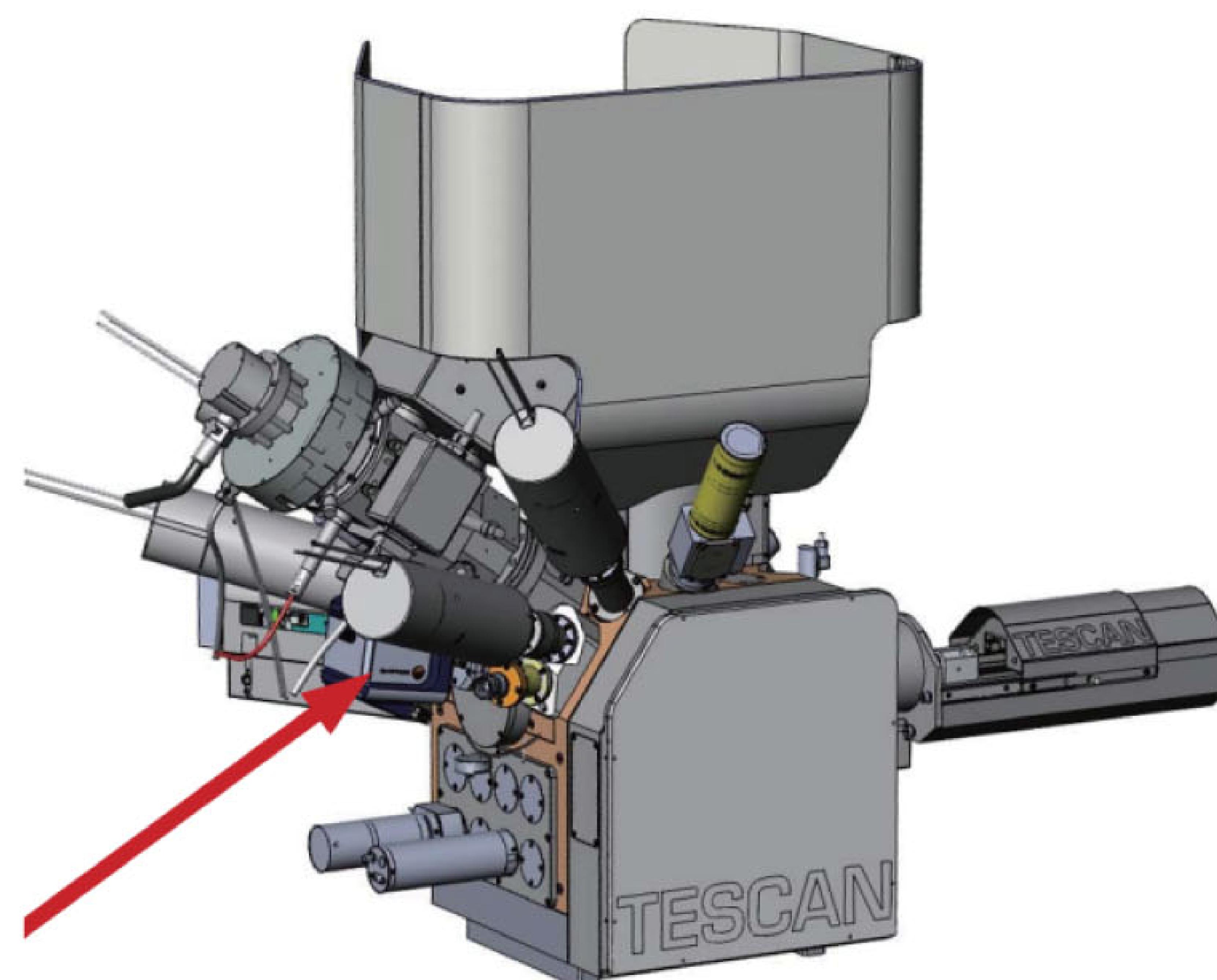
Triglav™ 型超高分辨场发射 SEM 镜筒

- 肖特基场发射灯丝，保证使用寿命可达2年
- 采用 TriLens™ 三物镜设计，可提供超高分辨模式，无漏磁分析模式和电子束无交叉模式
- 镜筒内的二次电子探测器和带能量过滤功能的轴向背散射电子探测器
- 电子束着陆能量: 200eV-30 keV (减速模式下 10 mm @ 最大 WD)



Orage™ 离子镜筒

- 液态镓离子源，预期最短使用寿命 3000 μAh
- 配置压电驱动光阑变换器，30 孔光阑
- 静电束闸，配置法拉第杯
- 离子束能量范围: 500 eV-30 keV
- 探针电流: < 1 pA - 100 nA
- 最大视野: 1 mm @ 10 ke



电子束分辨率

- 1.2 nm @ 1keV
- 0.9 nm @ 1 keV (样品台偏压, 减速模式下) *
- 0.6 nm @ 15keV
- 0.5 nm @ 30 keV STEM *

低真空分辨率

- 1.5 nm @ 30 keV, GSD 探测器*
- 3.0 nm @ 3 keV, GSD 探测器*

离子束分辨率

- 2.5 nm @ 30keV

主要特点

- ✓ 业内最佳的高分辨率FIB, 即使在低电压下也可以实现高质量超薄TEM薄片制备。
- ✓ 电子束无交叉斑设计, 可以在超低着陆能量下实现电子束敏感样品 超高分辨成像。
- ✓ 内置优异的图形引擎DrawBeam™, 实现高精度的电子束和离子束纳米图形加工。
- ✓ 多气体注入系统可选配不同类型气体, 扩展了纳米加工能力。
- ✓ 强大的样品室扩展和样品台扩展能力, 可实现12英寸晶圆检测。
- ✓ 模块化电镜控制软件, 用户可实现高级别自定义。
- ✓ 便捷的模块化Essence™电镜操作软件实现多用户分级操作、管理。